

応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

第25回「イオンビームによる表面・界面の解析と改質」特別研究会のご案内

主催：応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

協賛：日本表面真空学会、日本物理学会

記

日時：2024年10月16日（水）13:00－17日（木）15:00

開催形式：現地会場のみでの開催

現地会場：日本原子力研究開発機構 JAEA Tokai Mirai Base 3階研修室
(JR東海駅から徒歩6分程度)

内容：イオンビームを利用した表面・界面の各種解析および改質に関わる基礎と応用

招待講演：数件、一般講演：10数件程度

招待講演

・ Prof. Marko Karlušić, Ruder Boškovic Institute (Croatia).

「Role of the ion track formation threshold in the nanostructuring of materials by swift heavy ion beams」

その他

参加費：応用物理学会 薄膜・表面物理分科会会員 1000円、協賛団体会員・関連団体会員（日本表面真空学会、日本物理学会、応用物理学会） 2000円、一般 3000円、学生 無料、招待講演者 無料

講演申込み締め切り：8月30日（金）

A4で1頁のアブストラクト（英文）を提出して頂きます。

アブストラクト提出：<https://www.t.kyoto-u.ac.jp/fs/qsec/ionbeam/2024/abstractsubmission>

参加申込み締め切り：9月30日（月）

参加登録：<https://www.t.kyoto-u.ac.jp/fs/qsec/ionbeam/2024/registration>

世話人：石川法人（日本原子力研究開発機構）

連絡先：〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方2-4

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 照射材料工学研究グループ 石川法人

Tel: 029-282-6089

E-mail: ishikawa.norito@jaea.go.jp